低速電子衝撃による吸着氣體の脫離 (第4報) 吸着水分子の層の厚さ並びに吸着素域の決定

石川 義 與

固體表面への氣體の吸消實驗は數多く行はれて,之等の結果を綜合する種々の等溫吸着式も 多く呈出せられた¹⁾。

就中,Langmuir の吸着式²は多くの實驗事實に可成よく適合するので,この吸着式が導き出された根本假定,即ち Langmuir の單分子層形成の假說は,吸將氣體の壓力が甚しく大でない時には、實驗的にも理論的にも多くの支持を得てゐる。

併し多分子吸着層形成說も古くより行はれ、之を支持する事質も多く見出された"。

固體表面が單分子層或は單原子層で酸はれた場合に、ヴァン・デル・ヴァールス吸着或は他の何らかの吸着が起らなくなるか、尚吸着が進行して多分子層が形成せられるかは未だ一義的な決定は困難である。

多くの吸着實驗が行はれたにも係らず、之が決定出來ないのは 氣體を吸着し得る真の固體の表面積を測定することが困難な爲である。. 巨視的には平滑な金属表面も結晶子 (crystallite) や裂罅 (fissure) が多く存在して、見掛けの表面積の數百倍にも述する面積を有することさへあるが、斯る固體表面に於ては氣體の吸着量が如何に正確に測定出來でも、その吸着層の厚さを決定することは出來ない。

表面積を決定する困難を避け、氣體の吸着量を測定せずに、直接に吸着層の厚さを知る方法 が種々工夫せられた。之等の方法には收容係數 (accomodation coefficient)⁵⁾, 熱電子放出 (thermionic emission)⁶⁾, 表面反射光の橢圓偏光 (elliptical polarization of light reflected from a surface)⁷⁾, 及び表面電位差 (surface potential)⁸⁾ 等の測定がある。

¹⁾ J. W. McBain, The Sorption of Gases and Vapours by Solids (Routledge, 1932).

S. J. Gregg, The Adsorption of Gases by Solid (1934).

²⁾ I. Langmuir, J. Am. Chem. Soc., 38, 2221 (1916).

³⁾ M. Polanyi, Verh. deut. phys. Ges., 18, 55 (1916).

S. Brunauer, P. H. Emmett and E. Teller, J. Am. Chem. Soc., 60, 309 (1938).

S. Brunauer, L. S. Deming, W. E. Deming and E. Teller, J. Am. Chem. Soc., 62, 1723 (1940).

⁴⁾ N. K. Adam, The Physics and Chemistry of Surfaces (Oxford, 1938) 246.

⁵⁾ J. K. Roberts, Some Problems in Adsorption (Cambridge, 1939).

⁶⁾ J. H. de Boer, Electron Emission and Adsorption Phenomena (Cambridge, 1935).

⁷⁾ J. H. Frazer, Phys. Rev., 34, 644 (1929): S. Silvermann, ibid, 36, 311 (1930).

⁸⁾ H. K. Walley and E. K. Rideal, Proc. Roy. Soc., A 140, 484 (1933).

著者は低速電子衝撃による吸着水分子の脱離を測定して先に吸着分子の電子狀態を知り得たが[®], 更に吸着水分子層の厚さ及び吸着素域 (elementary space) の半徑を決定することが出来た。

實驗結果よりすれば、自金表面の水分子の吸着層は水の蒸氣壓が飽和に近い様な場合には百分子層にも達する厚い分子層を形成し、凝縮すら生するが、低壓に於ては、單分子層一高本數分子層一をなして吸消してゐる。斯る吸着層に於ては一箇の吸着分子の占める白金表面積、即ち吸着素域 (elementary space) の大さは略吸着分子自身の大さに等しいことが判つた。

装置及び方法

装置及び方法は前報の論文™と全く同様であるので此處では省略する.

排 氯

二極管のガラス表面積は自金板の表面積約 1 cm² に比して著しく大である。 随つてガラス 器壁表面の水の吸着量も自金のそれに比して甚だ大で、三極管の管壁の排氣並びに管壁の吸着 狀態に関して細心の注意が必要である。

二極管の管壁及び自金板は敷時間 850°C 以上に加熱排氣し、特に自金板は電子衝撃に依つて赤熱し、吸蔽吸着氣體の排氣を行つた。常温に冷却後、二極管は液態空氣に浸したトラップに依つて保護し、他の蒸氣の侵入してこれに吸着汚染するのを防いだ。この方法によれば、低速電子衝撃によつては殆んど氣體の脱離が認められない良好な排氣状態が得られる。

實驗結果

白金表面への水分子の吸着

二極管に通するトラップに水の極微量を導入して、排氣を行ひながら蒸發させると水分子は 一部分二極管に流入して自金板及びガラス管壁に厚い分子層をなして吸着するが、尚排氣を絞 けると一端吸着した水分子が再び吸着表面より脱離する。

脱離した水分子は加熱陰極纖簾に衝突した場合には分解して永久氣體を生する。 この氣體 の量をピラニ真空計を用ひて追跡測定すると水分子の蒸發經過を知る事が出來る。

最初はビラニ質空計(感度 10-6 mm.Hg) によつて測定出來ない程多量の永久氣體を生するが、約二時間程は急速に排氣量を減少し、その後は漸減する傾向を示す。

⁹⁾ 石川発興, 本誌 17, 176 (1943):

¹⁰⁾ 石川義興, 本建 16, 86, 119 (1942), 17, 176 (1943).

衝撃實驗を行ふには更に排氣を積行して、排氣量が極めて少なく且つ定常的になつた狀態に 迄排氣した。

脫離實驗

一定電壓 (V) を掛けて放出する熱電子電流 (i) を加速し、陽極白金板上に吸着してゐる水分子に衝撃させた。この衝撃を蒙けた吸着水分子は或る少なる磁率 ε (10-3 程度) を以て、白金表面に於て解離、前期解離を生じ、原子及び遊離基 (OH) 或はそのイオンに分解する。分解生成物は自己の行する迎動エネルギーによつて吸着層を脱離するに至る。

三分間の衝撃を蒙けて脱離する永久氣體の量 4p をビラニ真空計を用ひて測定した。OH は 液態空氣の温度に迄冷却したトラップによつて捕集せられて¹¹¹, ビラニ真空計には水素分子の みが集まる。

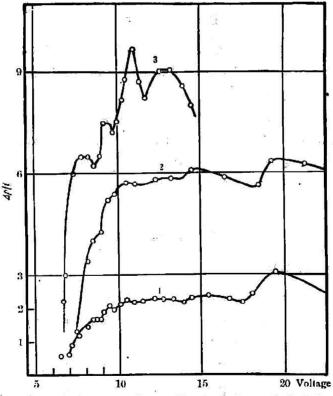


Fig. 1. The desorption curves of the multi-molecular layer of adsorbed water by electron impact. (The curves 1, 2, 3 in Fig. represent mono-, diand tri-molecular layer respectively.)

R. W. Campbell and W. H. Rodebush, J. Chem. Phys., 4, 293 (1936).
 K. H. Geib, ibid., 4, 391 (1936).

電子衝撃實驗は初め低速度の電子に依つて試み、順次加速電壓を高め、6V-30Vの範圍に 亙つて 0.3V より 0.5V の間隔を以て約30回行つた。

實驗結果は Apli と V の間の関係として第一圓に脱離曲線によつて表はした。

脱離曲線の特性

第一岡の脱離曲線に於て横軸には電子の加速電壓をボルトを以て表した。 之の電壓は實際 に適用した電壓より接觸電位差等に基く補正値 1.4 V を差引いて示した⁹・縦軸は 4p/i の大いさを表した。4p は電子衝撃による三分間の氣體の脱離量で、ビラニ真空計の振れ (cm) より測定した。i は一定電壓 (V) に依つて加速せられた衝撃電流 (mA) である。

脱離曲線の特性の第一は多くの風曲點を有することで、この風曲點に相當する電壓より吸着 分子の勵起電壓が測定出來ることは既に述べた處である⁹.

特性の第二は脫離曲線に高さを異にする三種の曲線が得られ、その外觀は夫々よく似てゐる 點である。

實驗より求めた 26本の脫離曲線に就て、比較的平坦な外觀を有する 10.5 V より 15 V の範圍の 4p/i 値を測定し、その値の出現回數とその値の大いさとの間の關係を求めて第二圖に 圖示した・

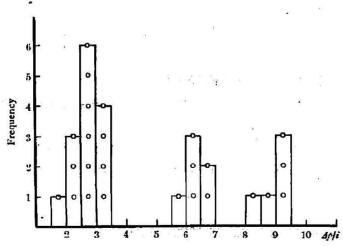


Fig. 2. Values Ap/i and their frequency.

此處に興味あるのは 4p/i の値の出現回數は連續な分布を示さないで、特に 4p/i の値 3, 6、9 の附近に集中するのが見られる。これは脫離曲線の著しい第三の特性と考へられる。即 ち斯る 4p/i の値の不連續性は吸着層の特異な性質に基くものであることが想像出来る。

Vol. XVII

一定加速電子電流の長時間連續衝撃による か/i 値の變化

水の吸消層に對して、衝撃電壓を變化せずに、一定に加速した電子衝撃を長時間に亙つて織 綴し、その間、4p/i 値の變化する模様を視た。第三圖は衝撃電子電流 0.3 mA、加速電壓 11 V に於て數時間連續衝撃を行つた場合の經過で、圖に於て擬軸には 4p/i の値を、横軸には電 子衝撃を加へた時間を示す。

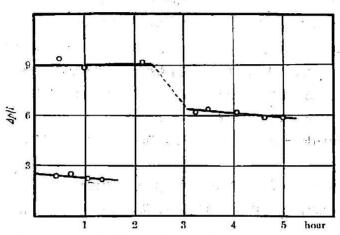


Fig. 3. The variation of Apli by the impact of electrons at the definite voltage.

 $\Delta p/i$ の値は二時間以上も略一定値 3.6,9 を保つてゐるが、時には衝撃開始後二時間を經て念に $\Delta p/i$ 値が9より6に變化する場合がある。併し一度6に下ると $\Delta p/i$ は更に二時以上も同一値を保つてゐる。

この事實は先の脫離曲線の高さが不連續的な値 3, 6, 9 を取らうとする傾向と相關聯するもので、3, 6, 9 は $\Delta p/i$ の特異値と考へられ、斯る現象は吸着層の構造の特異性に基くことが想像出来る。

然し 4p/i 値が特異値を取らうとする傾向は 二極管の管壁を液態空氣に浸さない時にのみ 生ずるので、器壁吸着層が液態空氣によつて凍結せられた場合には 4p/i 値の特異性は見ら れない。

二極管壁の吸着水分子層の白金表面吸着層に及ぼす影響

前項に述べた如く、實驗時の二極管壁の溫度が電子衝撃の脫離經過に大なる差異を生する。 この原因は器壁吸着水分子層に依るものと考へられる。

二極管壁を作ってゐるガラスは一般に氣體の吸着に對して複雜な性質を示すもので、既に知る如く適當な排氣處理を加へると水素原子等に對して Clean up 效果を示すがい,又多量の氣體を吸着することも知られてゐる。 特に水に對しては表面に複雜なシリカゲルの層を生す

る¹²⁾。

斯る器壁のガラスに對して加熱排氣處理 或ひは液態空氣を用ひて 冷却處理を行つた場合に 電子衝撃實驗に如何なる效果を生するかを以下に述べる。

i) 二極管の加熱處理の影響.

二極管に微量の水を導入して蒸發させて、器壁及び自金面に水の厚い吸着層を生じた後、單にポンプによる長時間の排氣を積けた場合に第1圖の(1),(2),(3) 曲線に相當する排氣狀態が得られたが、排氣と同時に二極管壁の加熱を併用すると短時間(約一時間以內)で上と同様な狀態に達する。

即ち 160°~200° 附近約 40 分加熱し器壁の排氣を行ふと第一圖の (3) に相當する吸着狀態が得られ、220° 附近に同一時間加熱すると脱離曲線の (2) に相當する狀態が得られる。又二個管を 200°C 附近に加熱しながら、同時に 300 V に加速した電子電流約 5 mA を以て約 3 時間自金板に衝撃すると、加速電壓 12 V 附近の低速電子衝撃によつては dp/i の値が1以下を示す様な吸着量の非常に少ない状態が得られる。

更に 350°C 以上に器壁を加熱排氣すると 50 V 以上に加速した電子の衝撃によっても殆ん ど氣體の脱離を生じない完全に近い排氣狀態に達する事が出來る。 この場合勿論加熱と同時 に自金板には高速電子衝撃を加へて排氣する。

ii) 二個管壁を 液態空氣で凍結する場合。

水を二極管に流入し蒸發後,直ちに二極管を液態空氣中に浸して,器壁吸着水分子を凍結させ,その蒸發を防ぎ,而る後自金板の吸着層に低速電子衝撃を加へると 4p/i の値は10.7 V の加速電壓の場合に於ても260 以上に達し,多量の水分子が自金板に吸着してゐることが判る.更に衝撃實驗を續行し,信回の 4p/i の値を測定し,その減少を調べると

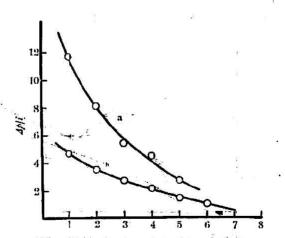


Fig. 4. The decrease of the value Apli after every experiment on impact.

約十囘の衝撃の後には Ap/i 値は30程度迄に減少することが判つた。

尙, 二極管の管壁を削と同様に液態空氣に浸して, 自金板の水の吸着量が比較的に多くない

¹²⁾ R. G. Sherwood, J. Am. Chem. Soc., 40, 1645 (1918).

J. W. McBain, Sorption of Gases by Solids (1932), Chapt. vii.

狀態に於て電子衝撃による脫離實驗を行ひ、毎囘の衝撃實驗による 4p/i 値を測定し、之を 第四圖に圖示した。

第四間に於て a 曲線は一定衝撃電慄 11V に加速した電子電流による脱離を示し、b 曲線は衝撃電壓を 10.6 V より 18.5 V 迄少し宛變じて脱離實驗を行つた場合の一例である。 兩曲線に闘する實驗數値を第一表に表示した。

第四岡は第三岡に比較すると大に趣きを異にして、4p/i 値の特異値を取らうとする傾向は見られず、電子の脱離能率 4p/i は毎回の衝撃實驗によつて連續的に減少する。

水分子と水素分子の共存吸着

適當な排氣處理によつて dp/i の値が 10.5 V より 15 V 迄の範圍に於て 3, 6, 9 を示す様な吸着層の狀態が安定に生するが,更に器壁加熱排氣を併用すると dp/i 値が 3 以下の値を取る様な吸着量の少ない吸着層をも生する。

この様な種々の水の吸清層に對して水素を接觸させて水素吸消の影響を視た。 水素は水銀柱三種程の壓力に於て二極管に導入して、敷時間放置後、之を排出した。 低速電子衝撃によって再び脱離曲線を測定し水素導入前後に於ける脱離曲線の變異を調べた。

第一間の(1),(2),(3) に相當する曲線は水素接觸による效果をあらはさないが、4p/i 値が 1 附近を示す脱離曲線に於ては第五圖に示す様に、水素特有の極大¹⁰を 10 V 附近に生じ、水素が水と同時に吸着してゐることが何る。

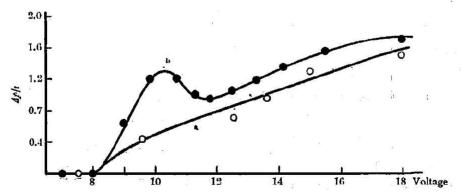


Fig. 5. The desorption curve of the co-adsorbed film of water and hydrogen molecules by electron impact.

- the desorption curve of the co-adsorbed film.
- O the desorption curve of the adsorbed water molecule.

第五岡の (a) は水素導入前の吸着水分子のみの脱離曲線を示し、(b) 曲線に水素導入後のもので水素と水との同時吸着の生じてゐるのを瞭らかにし得た。即ち 10 V 附近に於て生する脱離曲線の極大は水素分子の $1 \text{ <math>\Sigma_{a} \rightarrow 3 \text{ } \Sigma_{a}$ 、

動起に基く水素原子の脱離によるものである10 。

論議

脫離機構

吸着水分子の低速電子衝撃による脱離機構に就て前報に於て詳細に論じ、脱離現象が分子の 解離及び前期解離に基く事質を喰らかにした^{9,10}。

吸着層の構造

吸着分子が解離或は前期解離を生する場には、分子は一定速度に加速した電子と衝突しなければならぬ、吸着氣體分子の脱離量は有效衝突回數に比例するから、単位表面に於ける吸着分子の密度 c. 電子電流 i 及び電子衝撃による解離確率 c の積に比例する. 從つて氣體の脫離量は下式で表はすことが出来る.

$$\Delta p = \varepsilon \cdot c \cdot i \tag{1}$$

脱離曲線の高さ Ap/i 即ち電子の脱離能率は上式より解離確率 c と吸着密度 c との積に等しいことが判る

然るに第一岡に験らかな如く、脱離曲線は高さを異にする三種類を生じ、而も第二岡に見られる如く、その高さ 4p/i の値は倍數的な關係を持つ一定値 3,6,9 に失々集中する。

斯様に $\Delta p/i$ 値が非連續的な値を取らうとする傾向は (1) 式より考察すれば、 $\Delta p/i$ に比例 する吸着密度 c が非連續な値をとることによるものである。

然し多少の不規則性はあるにしても、同一原子が二次元的な排列をする金屬表面に於て、單分子吸着層が形成せられる場合に、吸着分子の密度が非連續的に變化するとは考へられない。 斯る非連續的な値を取る理由は常然吸着層の構造の多重性に随せねばならぬ。

從つて第一岡の(1),(2),(3) に相當する曲線は夫々吸着層が單分子層,二分子層,三分子層を形成することによつて生じたものと考へられる。4p/i の値に簡單な数値的な關係を持つのは層の構造の規則性に基因することを豫想させる。

今吸着層が三分子層よりなる場合に就で考へると

(1) 式を用ひて、第三届目を通過する場合、電子の脱離能率は下式で示される。

$$\Delta p_3 = \varepsilon_3 c_3 i \quad \therefore \quad \Delta p_3 / i = \varepsilon_3 c_3 \tag{2}$$

第二層目を通過する場合には、他子の一部は第三層の吸着分子を解離させてそのエネルギー を失ふので一定加速された他子の數は減少する。

$$\Delta p_2 = \varepsilon_2 c_2 \left(i - \varepsilon_3 c_3 i \right) \quad \therefore \quad \Delta p_2 / i = \varepsilon_2 c_2 \left(1 - \varepsilon_3 c_3 \right) \tag{3}$$

(原報) 石川 義 興

198

Vol. XVII

更に第一層目を通過して金屬に達する場合。

$$\Delta p_1 = \varepsilon_1 c_1 \left\{ i - \varepsilon_3 c_3 i - \varepsilon_2 c_1 \left(i - \varepsilon_3 c_3 i \right) \right\}$$

$$\therefore \Delta p_1 / i = \varepsilon_1 c_1 \left\{ 1 - \varepsilon_3 c_3 - \varepsilon_2 c_2 \left(1 - \varepsilon_3 c_3 \right) \right\}$$
(4)

介添字 1, 2, 3 は吸着層の第一層目、二層目、三層目に關することを示す。

前報⁹の實驗結果に於て,吸着層の水分子の電子狀態は氣相,液相の水分子の電子狀態と殆んど變りがないことが決定出來たから,電子衝撃による水分子の解離確率 ε は各吸着層の分子に就ても略々同一であることが像想出來る。 各層の吸着分子の解離確率を同一として次式の如く置く・

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon_3 = \varepsilon$$

 ε の値は c=1 と假定して第一圖の曲線 (1) に関して計算すると 4×10^{-4} molecule/electron 程度になるが ε がこれよりも大きくなるとしても、その高次の項は無視出來る程小さいから (3), (4) 式の ε の二次以上の項を消すと電子が第一、第二、第三の各層を通過する場合の脱離能率 4n/i は夫々 第一層に於て $4p_1=\varepsilon_1c_1$

第二層
$$\Delta p_2 = \varepsilon_3 c_2$$

第三層 $\Delta p_3 = \varepsilon_3 c_3$

如くなる.

吸着分子層が單分子層,二分子層,三分子層をなす場合の電子の脫離能率 Ap/i は特異値 3,6,9 を取ることが脱離曲線の特性より割つてゐる。各多分子層を電子が通過する場合の脫離能率は各吸着層の脫離能率の和と考へて次式の如く置ける。

$$\left(\frac{\Delta p}{i}\right)_{\text{單分子層}}:\left(\frac{\Delta p}{i}\right)_{=\text{分子層}}:\left(\frac{\Delta p}{i}\right)_{=\text{分子層}}:\left(\varepsilon_{1}c_{1}+\varepsilon_{2}c_{2}\right)$$
$$:\left(\varepsilon_{1}c_{1}+\varepsilon_{2}c_{2}+\varepsilon_{3}c_{3}\right)$$
$$=3:6:9 \tag{5}$$

之を計算すると らーなーに が得られる.

即ち水分子の多分子居が形成せられる場合には、各層の表面密度が同一である様な構造をとる必要がある。分子が斯様な排列をする為には吸着居は充塡せられた状態をとるから、吸着分子層には突起した部分や吸着層の穴が存在し難い事を示してゐるものと考へられる。 この事 曾は結晶面の生長の場合に於ても動力學的な考察より同様に推論されてゐる。。

吸着水分子層に於ける吸着素域 (Elementary space) の半徑の決定

既に述べた如く吸着水分子層は多分子吸着層を形成し、且つ吸着層は水分子をもつて充塡せ

¹³⁾ M. Volmer, Kuctik der Phasenbildung, (Steinkopff, 1939) 32.

られてゐるものと考へられる。

斯様な多分子吸着層に低速電子を衝撃して吸着分子を脱離せしめ、その層の厚さの減少を測定して白金吸着表面の吸着素域 (elementary space) の半径を決定し得た。此實驗を行ふには器壁吸着水分子が白金面に飛來することを極力避けなければならぬので、器壁を充分深く液態空氣內に浸して、吸着分子を完全に凍結して分子の移動を妨げた。

脱離曲線の特性(第二圖)より知られる如く何報電限 $10.5\,\mathrm{V}$ より $18\,\mathrm{V}$ の範圍では 4p/i の値は 3.6.9 の如き不連續的な倍數關係を示す。 4p/i 値が 3 である時には完全な單分子層が形成せられることが想像出来るから、今任意に實驗を行つて 4p/i を測定すれば $-\frac{1}{3}$ $\frac{4p}{i}$ の値より吸着層が幾分子層よりなるか決定し得る。 數分子層の厚さを有する吸着層に對して $10.5\,\mathrm{V}$ より $18\,\mathrm{V}$ の範圍で低速電子衝撃を行つて、次々に 4p/i の値を測定し、失々

$$\frac{\Delta p_1}{i_1}$$
, $\frac{\Delta p_2}{i_2}$, $\frac{\Delta p_3}{i_3}$ $\frac{\Delta p_n}{i_n}$ \geq $+3$.

この場合, 多分子層の厚さは夫々

$$\frac{\Delta p_1}{3i_1}$$
, $\frac{\Delta p_2}{3i_2}$, $\frac{\Delta p_3}{3i_3}$ $\frac{\Delta p_n}{3i_n}$

となつて漸次減少する.

n 回の衝撃實驗を行つた後の層の厚さの減少は次式で表し得る.

$$-\frac{1}{3}\left\{\frac{\Delta p_1}{i}-\frac{\Delta p_n}{i}\right\}$$

この間に脱離する氣體の量は下の如くなる.

$$\sum_{1}^{n-1} \Delta p_{n-1}$$

 随つて一層を形成する分子の數は脫離氣體分子數を層の厚さの減少で除すると得られる。又 電子衝撃を蒙ける表面積を 8 とし、その單位面積に吸着する分子の數を n。とすれば、衝撃 を蒙ける表面に於て單分子層を形成する分子の數は n₀S であらはし得るから下の如き關係が 存在する。

$$2\sum_{1}^{n-1} dp_{n-1} / \frac{1}{3} \left\{ \frac{dp_{1}}{i_{1}} - \frac{dp_{n}}{i_{n}} \right\} = u_{0}S$$
 (6)

之を變形すると

$$\frac{1}{3} \left\{ \frac{\Delta p_1}{i_1} - \frac{\Delta p_n}{i_n} \right\} = \frac{2}{n_0 S} \sum_{i=1}^{n-1} \Delta p_{n-1} \tag{6'}$$

(6) 式のた邊の恒數2は吸着水分子が電子衝撃によつて II と OII に解棄する場合に OH は液態を氣で冷却せられた器壁に完全に吸着凍結せられる^{III}故に、二分子の水より一分子の水

素が生する事を示す。 随つて解離した吸着水分子の数は脱離水素分子の数の二倍となる。

(6') 式に於て a_nS を除いては悉くの量が實驗的に測定し得る。今 $\frac{1}{3}\left\{\frac{-dp_1}{i_1}-\frac{dp_n}{i_n}\right\}$ 及 $\sigma = \frac{1}{3}dp_{n-1}$ の二量を夫々座標にとつて作闘すれば原點を通る直線が得られる筈である。且つ 直線の何斜より n_nS を決定出來る。

斯る直線關係の存在することは第四周の二つの曲線に就て之を確めることが出來た。第六圖は前記曲線に關する實驗値を第一表より求めて(6')の關係式を圖示したもので、原點を通過する直線上に實驗的に求めた各點が乗つてゐるのが見られる。

單分子層を形成する分子數 noS はこの 直線の傾斜より知り得るから衝撃面積 S を實驗的に決定出來れば吸着素域 (elementary space) の大いさを決定出來る。然 し S は陰極纖維より放出した電子が陽 極白金板を衝撃する面積であつて,直接 に測定は困難であるし,又幾何學的に求 めた表面積に數倍する有效衝撃面積を取 らねば真の表面積を示し得ない。

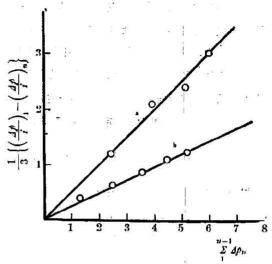


Fig. 6. The linear relation between the desorption amount $\sum_{n=1}^{n-1} dp_{n-1}$ and the decrease of the thickness of the adsorption layer $\frac{1}{3} \left\{ \left(\frac{dp}{i} \right)_1 - \left(\frac{dp}{i} \right)_n \right\}$

熱電子放出の際の空間電荷の理論によれば、熱電子電流は空間電荷の影響を受けて次式に示す如き電流を生する¹⁰・

$$i = 2.33 \times 10^{-6} \frac{V^{\frac{2}{4}}}{d^2} S$$
 (7)

d は兩極間の距離 (cm) で、S は陽極の有效衝撃面積 (cm²)。V は兩極間に掛けた電壓である。本實驗に於ける如く陰極に沿ふ電位變化 E, が陽極電壓 V に比して無視出來ない程度の 電壓を持つ場合には、(7) 式より率ろこの影響による補正を加へた下式がよく適用出來る¹⁰。

$$i = \frac{2.33 \times 10^{-6}}{d^2} V \frac{4}{4} \left\{ 1 - \frac{3}{4} \times \frac{E_f}{V} \right\} S_{calc} \tag{8}$$

(8) 式に於て V は陽極電壓, E, は加熱電流による陰極の兩端の電壓降下で, その實測値

¹⁴⁾ I. Langmuir, Phys. Z., 15, 348 (1914).

i5) G. Kusunose, Proc. I. R. E., 17, 1706 (1929).

Curve a.

は 3V である。(8) 式を用ひて、 i,d,V,E_J が實測出來るから有效陽極面積 S_{colo} の大いさを決定出來る。

二極管壁を液體空氣に浸して試みた電子衝撃實驗,即ち第四周の (a) 及び (b) 曲線に關して, (6') 式及び (8) 式の計算に必要な實驗上の諸數値を整理して第一表に表示した。

Table I.

Numerical Values of Experiments on Impact.

No. of Impact	Δp	" Σ Δβ	i 1	$\left(\frac{\Delta f}{i}\right)_{n}$	$\frac{1}{3} \left(\frac{\Delta f}{i} \right)_n$	$\frac{1}{3}\left\{\left(\frac{\Delta p}{i}\right)_{1}-\left(\frac{\Delta p}{i}\right)_{n}\right\}$	V 95	Scale (cm²)
1	2.4	2.4	0.205	11.7	3.9	0	36,5	0,12
- 2	1.5	3.9	-0.185⊶	8.1	2.7	1.2	36,5	-0,11
3	1.2	5.1	0.222	5.4	1.8	2.1	36.5	0.13
4	0.9	6.0	0.200	4.5	1.5	2.4	36.5	0.12
-5	0.6	6.6	0.222	2.7	0.0	3.0	36.5	0.13

No. of Impact	Ap	1 2 3	i	$\left(\frac{\Delta p}{i}\right)_n$	$\frac{1}{3}\left(\frac{\Delta f}{i}\right)_n$	$\frac{1}{3}\left\{\left(\frac{\Delta p}{i}\right)_{1}-\left(\frac{\Delta p}{i}\right)_{n}\right\}$	·v	V%	Scale (cm²)
1	1.31	1.31	0.27	4.7	1.57	0,	10.6	34.3	0.171
2	1.16	2.47	0.33	3.5	1.17	0.4	11.6	39.5	0.177
3	1.08	3.55	0.38	2.8	0.93	0.64	12.6	44.7	0.177
4	0.90	4.45	0.41	2.15	0.71	0.86	13.5	49.6	0.170
5	0.73	5.18	0.52	1.4	0.47	1.10	15.5	61.0	0.171
6	0.69	5.87	0.69	1.0	0.33	1.24	18.5	79.6	0.170

曲線 (a) は第一表に示される如く一定衝撃追隊 (11 V) に依つで脱離實驗を行つた場合の一

例である。表に見る如く (8) 式を用ひて計算して得た Soute は 0.125 cm² を示す。

以上の實驗及び計算より吸着素域の半徑を決定すると、a 曲線よりは 1.17 Å が得られ、b 曲線より 1.0 Å が得られた。

水分子の半径の測定は種々の方法に依つて行はれ、第二表は種々の方法で求めた半径の大さを示す¹⁶⁾。

Table II.

Molecular Radii of Water Molecule in A Units.

	Radii	Experimental Methods			
1	2.29	From data on: Viscosity, heat conductivity and diffusion.			
I	1,36	Viscosity.			
- : T	1.44	Volume correction in van der Waal's equation			
Ŋ	1.17	Volume correction in Wohl's equation.			
γ	0.67	Quenching of mercury fluorescence.			
V	1.38	X-ray analysis of the structure of ice.			

實驗的に求めた吸着素域の半徑 1.17Å は從來の實驗結果 1.38Å に可成よく一致する。著者の實驗に於て二極管の兩極間の實測距離を 0.2 cm としたが、この距離の精密な測定は困難である。 又表面吸着分子の移動は極力避けねばならぬがこの移動を完全に止めることは實驗上極めて困難である。移動が超れば吸着素域を減少する様な影響を及ぼすから、上の半徑の差は此様な實驗誤差に基くものと考へられる。

然し白金表面の吸着水分子の吸着素域の半徑が水分子の半徑に略等しいことは吸着層に於て分子が充塡せられた狀態に排列してゐることを示すもので、前項に於ける第(5)式の示す吸着層の構造が正しいことを證明してゐる。

更に第二層、第三層に於ても全く同様な充塡した排列を取り得る事は第六圖の直線關係が數 分子層の範圍に亙つて存在する事から之を證明出來る。

以上よりして水分子は多分子層に吸着して各層は空所のない充塡した排列を取り、相隣つて ねる分子間の距離は水分子が 水素結合をなす時の距離に等しい程度に 近接してゐることが判 る、又吸着層表面に於ても缺所や著しい突起部分は存在してゐないことが推論出來る。

吸着層の性質

i) 多分子吸着層の安定性

二極管に水の蒸氣を導入した直後に於ては電子衝撃實驗より求めた 4p/i 値は 260 以上をも示して、分子層の厚さは 90 層にも達してゐるものと思はれる。然し斯る厚い吸着層は低壓に於て吸着水分子が蒸發して層の厚さを減少し。長時間の排氣後には單分子層一高々數分子層一を生じて割合に安定に存在してゐる。斯様な吸着層は前項に述べた如く、吸着分子が一種の結

¹⁶⁾ Landolt-Börnstein, Physikalisch-chemische Tabellen, Erg. Bd. I, (1927) 69.
A. C. G. Zemansky and M. W. Mitchell, Resonance Radiation and Excited Atoms (Cambridge, 1934).
W. H. Barnes, Proc. Roy. Soc., A 125, 670 (1929).

晶的な 排列を示すものと考へられ、その表面には突起部分や 吸着分子の缺けた穴は存在した
い・

結晶表面に於ける構成分子或は原子はその存在する位置(稜,角,面等)に依つて位置のポテンシャルエネルギーを異にする事實が考察せられてゐる。 即ち平滑な面上に孤立して存在する分子の結合エネルギーは 平滑な面を構成してゐる 分子の結合エネルギーに比して甚だ小さい。 同様なことが結晶面の種々な 位置に存在してゐる 他の分子 或は原子に就ても 考へられる。

水の吸着層を一種の結晶構造を有するものと考へると、器壁より飛來した水の分子が平滑な吸着層上に吸着せられても、その結合のエネルギーは完全に平滑な吸着層を構成する水分子の結合エネルギーに比して少であるから單時間しか表面に止り得ない。 又附近に吸着層の穴があれば移動して結合エネルギーの大きな空所を充填することも考へられる。 之に反して平滑な吸着面を構成する水分子は結合エネルギーが大であるから、吸着面に穴を作つて脱離する確率は非常に少ない。 随つて氣相の蒸氣壓が極めて低いときには穴を持たない平滑な吸着層が安定で存在し得る。これより脱塵曲線の第二、第三の特性が生する理由を説明することが出來る。

斯る安定な吸着層に低速電子の衝撃を長時間續けても、吸着分子の脱離によって生じた吸着 層の穴は器壁吸着分子の飛來して之を補充する為に、 4p/i 値は第三岡に示す如く長時間に亙 つて一定値を保つてゐるが、飛來分子が減少して比較的に大きな穴を生じた場合に大なる穴に 隣る分子の結合エネルギーは小穴に隣るものに比して小さいから、穴を益々大になる傾向を生 じ、比較的短時間の後には次の平滑な吸着面が顯れて之が安定化することが想像される・4p/i 値の9より6に急に變する現象を第三岡に見たが上の如き機構に基くものと考へると 説明出 來る・

ii) 水素分子の吸着水分子層への舉動

水の吸着層へ水素を導入接觸せしめた後、水の脱離曲線の形の變化より水素の共存吸着の成否を見た。 第一圖の (1), (2). (3) の曲線に相當する水の吸着層に於ては水素の同時吸着は認められないが、第五圖より瞭らかな如く。同時吸着の可能な場合は 4p/i の値が1附近の場合である。 4p/i=3 に於て單分子層が完成せられてゐるものと考へられるから。 4p/i=1 に於ては白金表面の約1/3 が水分子によつて蔽れ。 残り2/3 は未吸着部分である。 水素は斯る白金板の未吸着部分に吸着して水分子と同時に吸着するものと考へられる。 4p/i が更に増加して3に近づくと白金の未吸着部分を減じて遠ひには 4p/i=3 に於ては水の單分子層が形成せられ。 最早水素の吸着は生じない。 水素は白金面には吸着し得るが、水の吸着層上に更に吸着することはない。 斯る吸着分子間の結合力に開して後に述べる。

白金表面の水の吸着層と二極管壁の吸着層の關係

白金表面吸着層に二時間以上も連續して低速電子衝撃を加へ、計算よりすれば數十分子層に相當する吸着水分子が脱離してゐるに拘らず、4p/i 値は常に一定して、二分子層、三分子層が安定に存在することを示してゐる(第三圖參照)。之が原因は器壁吸着分子の飛來して補充することによるものと考へられるが次の實驗事實は之を證明してゐる。 實驗の項に述べた如く補給源である器壁に對して加熱處理及び液態空氣による凍結の二方法を用ひ、其の補給を妨げると白金吸着水分子層の厚さを急激に減少する。 ガラス表面が白金板に比して甚だ大きい表面積をもつてゐること及びガラス表面には一種のシリカゲル狀態になり多量の水分子を吸着吸藏し得る事を考へる「ひと補給量の大なる理由が說明出來る。

従つて白金吸着層と ガラス器壁の水の吸着層の間には 常に吸着平衡が存在してゐるものと 考へられる。

白金板上の水素吸着層と水の吸着層の差異

水の吸着層に電子衝撃を加へた場合には第一端に示す如く高さを異にする腕雄曲線を三種類生にた、然るに水素を吸着させた場合には一種類の腕雄曲線しか得られない¹⁰・

既に述べた如く脱雑曲線の高さを異にするのは多分子層吸着を生じてゐる結果であるから 水素の吸着の場合には水の吸着の如き多分子層を形成せず單分子層を形成することが判る。又 この事實は水素と水の同時吸着の際の脱離曲線の傾向よりも推論出來る。

水の吸着層に関して第一式を用ひて s の大さを計算し、衝撃電子の解離確率を計算すると 10.5 V より 15 V の範圍では絕對收量 3.8×10⁻⁴ molecule/electron であることが判る

吸着水素分子の「 $\Sigma_0 \to {}^3\Sigma_n$ 勵担の際の絕對收量は實驗的に 6.4×10^{-6} molecule/electron 程度であることが知られてゐる 10 .

水素の場合に吸着密度を1と假定すると、吸着水分子と吸着水素分子の電子衝撃による解離 確率は6倍に近い差があることが判る。

實際吸着氣體の脫離實驗を行つた場合に、器壁を液態空氣に浸すと水の吸着層に於ては第四 圖に示す如く、毎回の衝擊實驗後に 脱離曲線が著しく 降下して表面密度の急激な減少が生じ てゐることを示すが、吸着水素分子の層に於て斯る表面密度の著しい減少は顯れない。

この差異の生する原因として、第一は水素の電子による 解離確率は 水の解離確率に比して 1/6 の程度少で實驗時に於ける脫離量が少ない。

第二は水素分子の大いさが水のそれに比して小さいから表面の吸着分子数は水に比し大である事も理由として考へられる。今後の實驗に於ても形の大きい解糠確率の大きな分子はその脱離曲線は表面密度の影響が著しく顯れて、脱離曲線の急激な減少が豫想され、實驗上測定が困難と思はれる。 この場合にはピラニ感度を更に高めて少ない脱離量を以て實驗を行ふ必要

No. 5

205

がある.

吸着分子層に働く力

氣體分子が自金表面上に吸着する場合に、吸着氣體の種類によつて分子層の厚さに差を生じる。即ち、水素が自金板に吸着せられる時には單分子層しか生じないが、水分子の吸着層は多分子層を形成する。 斯る吸着層の厚さの差を生じる理由は當然分子層に働く力の差異に悲くものである。

單分子層が形成せられる際には、金屬表面と吸着分子の間の力が主であるが、多分子層に於ては、層を形成する吸着分子相互間の力が重要になる。

金屬表面に氣體分子が吸着して、之と化學結合を生じない場合、或は吸着分子の角離を伴はない場合は、斯る吸着はヴァン・デル・ヴァールス吸着の名で呼ばれ、之の結合力はヴァン・デル・ヴァールス力によるものである。この力は近時、量子理論の解明に「「依つて力の本性が明らかにせられ、配位 (orientation effect)、誘起 (induction effect) 及び分散 (dispersion effect) の三效果より生する力の各々の寄與も計算せられてゐる。 初めの二つの效果は靜電氣力による古典論的な力」のあるのに反して、分散力は新しい量子力學的な效果で、無極性分子の金屬表面に於ける吸着力の基因とせられてゐる」。後者の吸着力に關しては、金屬の特性を考慮した計算が行はれ、金屬表面に於ける分子吸着の研究はこの方面より解決されつ」ある。

併し分散力は距離の六乗に逆比例して、減衰するから金属表面と吸着分子間の力は距離の増大に伴つて著しく減少し、多分子層が形成せられる際には吸着分子間に働く力が重大な影響を現はす様になる。 斯る多分子層の構造は一種の分子性結晶に類似したものと考へられる。 その層形成のエネルギーを分子性結晶エネルギーと同様に、分散力によるものとすると分子性結晶の昇華熱の程度となり、酸素、窒素の如き無極分子に於ては 2 Kcal/mol 以下となつて實際多分子層形成が困難な理由を說明出來る。

水分子に於ても分散效果は甚しく大ではないから、この力のみで多分子層吸着を生じ得ない。併し水及びアンモニャの如き有極性分子に於ては配位效果が可成大である。配位效果に基く力はその力の性質が加算的(additive)でないから一般に多分子層を形成する様な大きい凝集力を期待することは出來ない²⁰。

¹⁷⁾ F. London, Z. Physik, 63, 245 (1930).

¹⁸⁾ W. H. Keesom, Physik. Zeits., 22, 129 (1921).

P. Debye, ibid., 21, 178 (1920).

¹⁹⁾ J. E. Lennard-Jones, Trans. Farad. Soc., 28, 883 (1932).

J. Bardeen, Phys. Rev., 58, 727 (1940).

H. Margenau and W. G. Pollard, ibid., 60, 128 (1941).

²⁰⁾ H. Margenau, Rev. Mod. Phys., 11, 1 (1939).

Vol. XVII

水素結合

水分子が多分子層を形成するには ヴァン・デル・ヴァールス 力以外の何等かの引力の存在が 豫想される。

一般に水、アンモニヤ分子等に於ては水素原子に基く水素結合 (hydrogen lond) の存在が 古くより知られてゐる 21).

この力の本性に関しては、双極子效果を否定した水素原子交換機構の如き極端過ぎる考へ方 も存在するが、兎も角、その力の型は、結合機構の嚴密な決定的な記述が困難な過渡的な型式 に属するものであらふ²⁵、従つてその力の大いさの如きも正確な計算は不可能である。

Pauling の問題の昇華熱等よりする大膽な複算によれば、水の水素結合のエネルギーは約4.5 Kcal アンモニャ分子の夫は 1.3 Kcal と推定せられてゐる²¹⁾。先の分散力に比して、可成大きい値を示してゐるので、多分子層形成の基因として有力に作用するものと考へられる。

斯る水※結合が多分子吸着層の起因と 考へられる實驗的な事實として 次の事實が舉げられる。

水楽結合が作られる場合には水分子が 2.5 Å-2.9 Å の距離に存在してゐることが知られてゐる。 水楽結合の存在にはこの程度の分子の近接が必要と考へられる。 實驗的に多分子吸菸 層に於て水分子間の距離は 2.3 Å 程度と考へられるから 斯る近接吸浴分子間に充分水素結合 の存在が豫想出來る。

更に、實驗結果より知られる如く水分子の多分子吸治層は規則正しい排列を取つて層を形成してゐることが判る。斯る吸治層の構造は一種の結晶的な性質をわするものと考へられ、氷の結晶構造と 關聯して考へるべきであらふ。 氷に於ては、水分子の酸素が 四面體的配置を取つて、その間を水素結合によつて結合せられてゐる²³⁾。 多分子吸治層に於ても水分子はこれに類似した配置をとつて層をなすことが豫想され、水素結合が之等の吸治分子を比較的に强く結合するものと考へられる。

又實驗的に水の吸着層上には水素の吸着層を生じないことが判つたが、水素分子の如き、電 氣的陰性度の少なる原子よりなる分子に於ては、吸着層を形成する水分子との間には弱い分散 力が働くのみで、水素結合の如き結合力を生じない。從つて水素は水の吸着層の上に吸着出來 ないことが説明出來る。

以上の事實は著者の實驗より 水素結合の存在を豫想せしめるものを 擇んだのであるが、尙

111

²¹⁾ L. Pauling, The Nature of the Chemical Bond (Cornell press, 1940) 284.

²²⁾ G. Briegleb, Zwischenmolekulare Kraft und Molekülstruktur (Ferdinand Enke, Stuttgar 1937), 73.

²³⁾ D. M. Dennison, Phys. Rev., 17, 20 (1921).

W. H. Bragg, Proc. Phys. Soc., 34, 98 (1922).

W. H. Barnes, Proc. Roy. Soc., A 125, 670 (1929).

水の吸着實驗に於て吸着熱の測定が行はれてゐる。

水が活性炭表面に吸着する際の後分吸消熱は 11.4 Kcal—9.5 Kcal/mol なることが測定せられた³⁰. 氷の昇華熱は 12.2 Kcal/mol であり、水の蒸發熱は 10.4 Kcal/mol であることが知られてゐるから、水が活性炭に吸着する場合に單五る分散力によって吸着するのではたく、可成强く、水素結合が働らいてゐることが判る。從つて吸着層が數分子層を形成する場合には水素結合によって結晶的な構造を取ることが豫想され得る。

以上述べた理由により水分子の 多分子層吸着を生するのは 吸消分子間に水素結合による力 が働いて、異なる分散力よりも强い結合をなすことに依るものである。

一般に吸着分子が多分子層吸着を生する為には分散力以外に可成り大きな分子間の力の存在することを必要とする。 水素結合の如き特種な分子間の力は之が基因として有力に働くものと考へられる。

要約

以上實驗結果を要約すれば、白金表面に水分子が吸着する場合、水の蒸氣駅が飽和に近い様な壓に於ては、百分子層以上の厚い吸着層を生じ凝縮すら生するが、充分排氣した白金面に於ては單分子層を主として生じ時には數分子層の厚さを有する多分子吸着層を安定に生する。

水素分子が單分子層のみを生するのに反して、水分子に於ては容易に多分子層が形成せられる。

斯る水分子の多分子層に就て、その有する種々の特性を調べたが、斯る數分子層の厚さを有する吸消層は結晶的な排列を示すものであることを明らかにした。

吸着層が斯る結晶的な構造をとるのは、之を構成する吸着分子間に分散力以上の强い凝集力 の存在を豫想させるが、之が水素結合に悲くものであらふと推論した。 實際吸着層の有する 種々の物理化學的な性質はこの力の存在を證明してゐる。

又斯る自金板上の吸着層は器壁の水の吸着層と密接な關係を有するもので, この兩者の間に 吸着平衡の存在する事實を瞭らかにした。

本實驗を行ふに當り,終始御整篤な御指導を賜はつた堀場先生に厚く感謝申上ます。又研究 費の補助を戴いた帝國學士院に感謝の意を表します。

> 京都帝國大學理學部化學教室 物 理 化 學 研 究 室

(昭和18年8月15日受理)

²⁴⁾ A. S. Coolidge, J. Am. Chem. Soc., 49, 708 (1927).

THE DESORPTION OF THE ADSORBED GASES BY THE IMPACT OF SLOW ELECTRONS. (IV)

The Determination of the Elementary Space and the Thickness of an Adsorbed Molecular Layer of Water.

By Yosioki Isikawa.

(Abstract)

By measuring the desorption of the adsorbed water molecules by slow electron impact, the present author has succeeded in deducing both the elementary space and the thickness of the layer of the adsorbed water molecules without measuring the area. He establishes that the adsorption of the water molecules upon a platinum plate is in the form of a mono-molecular—tri-molecular at the highest—layer under very low pressures, except in the case of the pressure of the adsorbate approximating to the saturated vapour pressure, when the formation of thicker layers and even condensation in bulk may occur.

Experimental Results and Discussion.

The apparatus and procedure used are the same as given in the preceding papers. (This Journal, 16, 86, 119 (1942), 17, 176 (1943).)

In the report, the author makes clear that the desorption phenomenon is due to the dissociation or predissociation of the molecules by electron impact.

The number of the collisions between the adsorbed molecules and electrons, which cause such dissociation and predissociation is proportional to the fraction of the surface covered with the adsorbed molecules e and the electron current i. Accordingly the desorbed amount Δp can be expressed thus:

$$\Delta p = \epsilon \cdot c \cdot i$$

where ε is the probability of dissociation by an electron impact. $\Delta p/i$: the height of the desorption curve is equal to the product of the dissociation probability ε and the adsorbed fraction c. In Fig. 1, however, the three desorption curves are found to differ in height, and in Fig. 2 the height, $\Delta p/i$, is seen in such a multiple relation as 3, 6 and 9.

Such discontinuity of the value of $\Delta p/i$ is due to that of the fraction of the covered surface c proportional to $\Delta p/i$. On a metal surface where the same atoms are arranged uniformly and two-dimensionally, though with some irregularity, it is not admitted that a monomolecular layer is discontinuously built up by the successively adsorbed molecules. The cause of such discontinuity is to be sought in the multiplicity of the structure of the adsorption

No. 5

209

layer.

The curves, (1), (2) and (3) in Fig. 1 are considered to correspond to the mono-molecular layer, di-molecular layer, and tri-molecular layer respectively.

As for such multi-molecular layers, let the fractions of the adsorbed surfaces of the first, the second and the third layers be represented by e_1 , e_2 and e_3 respectively. Suppose that the electron current i, after bombarding the layers and passing through them, reaches the interior of the metal. The ratio of the desorption efficiency dp/i of electrons concerning the mono-, di- and tri-molecular layers are as follows:

$$\left(\frac{\Delta p}{i}\right)_{\text{mono}} \left(\frac{\Delta p}{i}\right)_{\text{di}} : \left(\frac{\Delta p}{i}\right)_{\text{tri}} = \varepsilon_1 e_1 : (\varepsilon_1 e_1 + \varepsilon_2 e_2) : (\varepsilon_1 e_1 + \varepsilon_2 e_2 + \varepsilon_3 e_3) = 3 : 6 : 9.$$

On calculation, we obtain $c_1 = c_2 = c_3$. This shows that the adsorbed surface fractions of the multi-molecular layers formed are quite the same. Such arrangement of molecules requires a fully packed adsorption layer: namely such an adsorption film has scarcely any attachment and hole.

As seen in Fig. 4 when the adsorbed molecules on the diode wall are frozen out to prevent vaporization, $\Delta p/i$ values decrease after each experiment on slow electron impact. It is presumed that when $\Delta p/i$ value reaches 3, the platinum plate is covered with a mono-molecular layer of water moleculs, so that $\frac{1}{3} \frac{\Delta p}{i}$ corresponds to the thickness of the adsorption layer. The measurements of the decrease of the thickness of the adsorption layer by a series of electron impacts $\frac{1}{3} \left\{ \left(\frac{\Delta p}{i} \right)_1 - \left(\frac{\Delta p}{i} \right)_n \right\}$, of the desorption amount $\sum_{i=1}^{n-1} \Delta p_i$ and of the effective anode area S determine the radius of the elementary space of the adsorbed water layer by the relations, (6, 8) and its radius calculated 1.2 Å long is in fairly agreement with that of a water molecule 1.3 Å long from X-ray analysis of ice.

When a mono-molecular layer has been formed, a further heating and pumping produces an uncovered part on the platinum surface. As seen in Fig. 5, the introduction of hydrogen changes one into an adsorption layer where the molecules both of hydrogen and water exist simultaneously. This formation is possible only in the case when $\Delta p/i$ is smaller than 3.

In spite of the desorption quantity caused by more than 2 hours' electron impact which corresponds to several square centimeters mono-molecular film by calculation, the value of $\Delta p/i$ remains unchanged as seen in Fig. 3 and the film on the metal is not decreased in thickness. Nevertheless, the heating and pumping treatment of the wall of the diode above 200°C instantly decreases the value of $\Delta p/i$ below 2, that is, it decreases the thickness of the layer. It is considered that as soon as the adsorbed molecules on the metal are desorbed in consequence of electron impact, these are probably made up by the molecules adsorbed on the diode wall. When the adsorption layer of water on the wall is frozen with liquid air, the value of $\Delta p/i$, as seen in Fig. 4 becomes smaller by a series of electron impacts, and the constancy of the value of $\Delta p/i$ as in Fig. 3 is not maintained so long. This fact indicates that

Vol. XVII

there exists an adsorption equilibrium established between the adsorbed films on the metal and the wall.

The suggestion is made that the cause of the occurrence of multi-molecular adsorption is that between the adsorbates there are exerted strong forces of intermolecular attraction which reside in the formation of the hydrogen bond.

The Laboratory of Physical Chemistry,

Kyoto Imperial University.

(Aug. 15, 1943)